

半導体級シリコン単結晶 X 線測定装置 DX-7ANG-3

本装置は両側測定台あり、一侧はウエハーの notch を測定、反対側にインゴットとウエハーの端面及び基準エッジを測定。



ウエハーのエッジ測定可、
インゴットの端面とエッジを
測定するときに取り外し可。



ウエハーの notch 角度を測定

インゴットの端面とエッジを測定

装置の仕様

ウエハー/ インゴット	125~457mm, ± 1 mm
ウエハー厚み	100um 以上 over 100 um
結晶面を測定	100, 111, 110 及び各種測定角度
測定精度	$\pm 30''$
最小示度	1''
Notch 槽角度値	45°, 90°, 180°